

Kemet

平面研磨 机台系统与配件



Kemet

为什么要选择 Kemet (科密特) 平面研磨系统 ?

Kemet (科密特) 平面研磨抛光系统提供的平面抛光制程法, 效率最高、可靠性最好。

本公司生产的平面研磨抛光机和平面研磨抛光系统, 采用当今最前沿的尖端研磨技术, 与 Kemet (科密特) 金刚石产品配套使用时, 效果尤为出色。

Kemet (科密特) 金刚石产品具有高等的质量和粒度, 可在生产条件下可靠的实行精密研磨。

每种 Kemet (科密特) 金刚石产品都是一种特殊的混成品。混成品配料包括金刚石粉末和化学载体, 并且金刚石粉末具有特定的粒度和浓度, 除可实现切削和表面加工的最优化之外, 还便于清洗、耐受高温, 并且具备润滑功能, 可避免干透。

与传统的研磨方法相比, 采用 Kemet (科密特) 金刚石产品进行研磨可降低废料生成量, 可以说它具有更好的环境友好性。



行业领域与应用场合

航空航天

泵与阀门
涡轮机零部件
发动机总成
衬垫

泵与阀门

燃油泵
液压泵
机械密封
闸阀

技术陶瓷

氧化铝/氧化锆陶瓷
碳化硅
压电陶瓷
铁氧体



医疗设备

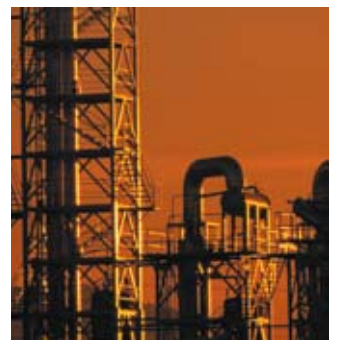
纤维镜
外科器械
人造膝关节
心脏起搏器零部件

数据存储

磁盘驱动器的磁头
磁带机磁头
光盘铸模
铁芯片

电子光学器件

平面光学器件
激光棒与棱镜
光纤
传感器



模具

铸模与镶块
印刷板
纵剪机刀片
挤压模

汽车

柴油机喷油器
安全气囊引爆器
活塞环
燃油泵



K e m e t (科 密 特) 尖 端 的 平 面 研 磨 技 术 的 好 处

- 显著降低研磨成本
- 让环境更加整洁
- 降低检验需求
- 表面加工作业简化
- 半熟练人员即可操作
- 高切削功能
- 快速抛光过程
- 参数预先设置
- 提高检验合格率
- 实现最优的平直度和表面光洁度
- 降低产品清洗难度
- 更好地利用机床的运行时间



金 刚 石 研 磨 料

Kemet



Kemet International是工业及科研用金刚石磨料的全球之一的制造商。

本公司提供范围广泛的标准配方，包括研磨液、研磨膏、悬浮磨料、凝胶磨料和研磨复合膏棒等。

我们的实验室具有50多年的经验，开发的专用配方运用于大多数研磨、抛光制程，其中既有基本的手工研磨作业，也有全自动的双面研磨系统。





Kemet (科密特) 标准金刚石研磨液

K 型

一种出色的通用型低粘度油/水乳剂，适合多数应用场合。

WA 型

水溶性金刚石研磨液，研磨/抛光中不能存在油基材料时推荐使用。

O 型

低粘度油溶性金刚石研磨液，清洗性更好。

特点

- **性能始终如一**
生产质量体系已通过英国标准学会 (BSI) 认证，认证号 QO5919 BS EN ISO 9002:1994。
- **精密超细表面加工**
微米尺寸规格众多，完全采用天然金刚石粉末，粒度公差低于国际公认标准。
- **高效率、经济性好**
金刚石粉末在专门配置的化学载体中均匀悬浮，确保能够达到最高的金刚石切削与抛光效果。
- **降低研磨成本**
适宜与 Kemet (科密特) 电子分配系统配套使用，杜绝浪费、降低研磨成本。
- **产品清理简便**
金刚石研磨液产品经过专门配方，零件清理简便。

技术数据		微型粒度
最后抛光	1/10 1/4 1/2 1 2 3	Kemet (科密特) 金刚石液通常有 400 克，2000 克或 2500 克单位包装。也能提供特别的微型粒度，配方，颜色或包装。 具有标准浓度或高浓度，也可依照需求而定制。
研磨和抛光	6 8 10 14	
高切削	25 45	

Kemet (科密特) 润滑液

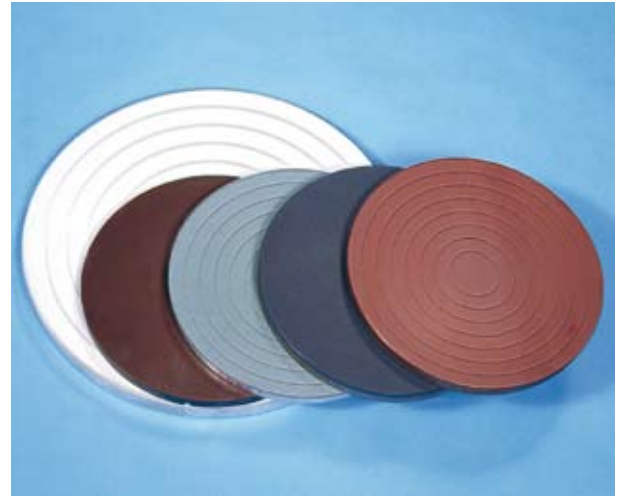
这种专门开发的润滑液，可确保 Kemet (科密特) 金刚石研磨液达到最高的切削和抛光效率。推荐使用的润滑液共有两种，其中的 K 型属于油基润滑剂，W 型则是水基的。

Kemet

平面研磨盘

Kemet（科密特）复合研磨盘，以合成树脂、金属颗粒及其它材料均匀混合后制成。

这些研磨盘堪称当今尖端研磨技术的理想拍档，与Kemet（科密特）金刚石研磨液更是绝佳配搭。



特点

- 坚固固定金刚石颗粒，确保切削的高效性和部件表面加工的可重复性。
- 具备延展性，对金刚石颗粒起到缓冲作用，避免伤及工件。
- 产品具有多种硬度值，软的材质也可采用金刚石颗粒安全地研磨，而不会发生金刚石颗粒渗入。
- 具备散热能力，避免被研磨表面上产生层流。
- 平直度优化控制简便。
- 本公司生产多种研磨/抛光盘产品，可匹配盘直径最高3000mm的各类研磨机。
- 安装在铸铁背板上，可提高稳定性。

K e m e t (科 密 特) 平 面 研 磨 盘

Kemet (科密特) 标准研磨盘

Kemet(科密特)标准研磨盘，一般都安装在一块铸铁背板上供货，可提高稳定度。在平面精度和表面加工精度要求较高的常规及大负荷工作中推荐采用。

Kemet (科密特) 拆卸式研磨盘系统

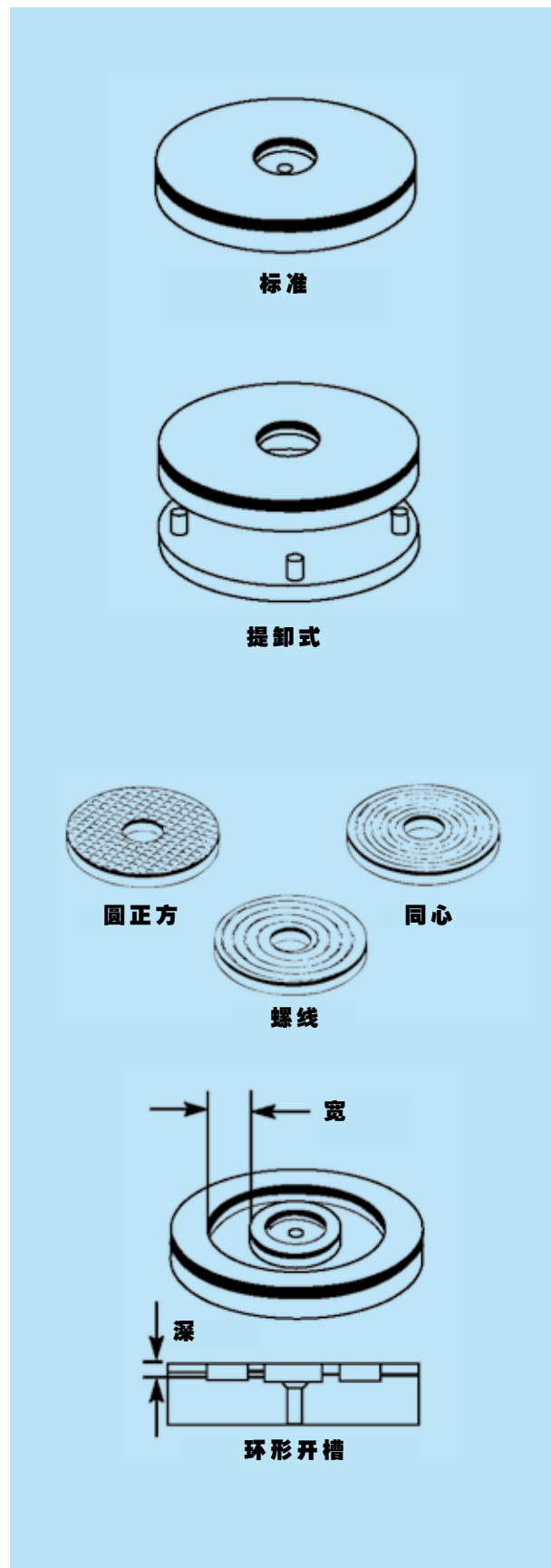
Kemet(科密特)研磨盘也包括拆卸式研磨盘，适用于直径最高610mm(24英寸)的研磨机。研磨盘安装于铝制背板上供货，通过三根销子在铝制驱动板上定位。拆卸式研磨盘更换简便。推荐在平面度要求一般而光亮度要求精密的小负荷工作中使用。

开槽研磨盘

Kemet(科密特)研磨盘在供货时可开槽，以适合特定应用。

Kemet (科密特) 环形开槽盘

Kemet(科密特)环形开槽盘经过专门设计，用于燃油泵齿轮端面和卸压阀盖等多种零件的轴肩精密研磨。订货时需要规定研磨盘开槽宽度和深度。



平面研磨机

Kemet

Kemet (科密特) 15

特点

台式精密金刚石平面研磨抛光机

Kemet(科密特)15台式研磨机采用刚性金属构造，配有高度可调式工作台。机床包含一个数字过程计时器和一套全自动金刚石研磨液分配系统。

选配项目

- 变速
- 适用于提卸式研磨盘系统

- 适合台式安装。
- 可生产出高精度的光学平面。
- 降低研磨成本-Kemet(科密特)电子分配系统，能够准确地向研磨盘定量分配金刚石磨料。
- 降低消耗量-金刚石磨料和无毒流体用量较小。
- 装配研磨剂系统：泵，研磨剂桶和可调整流量控制，可用于在研磨或修正研磨盘。
- 电气系统符合EN 60 204标准。
- 适用于特殊的研磨应用场合。
- 方便运送。



Kemet (科密特) 24

站立式精密金刚石平面研磨抛光机

Kemet(科密特)24焊装有刚性的管状截面钢架，用以支撑变速箱、驱动电机和工作台。拆卸式面板后方安装为一体。

研磨剂系统：泵，研磨剂桶，可调整液量控制系统及废料桶。

选配项目

- 变速
- 温度控制
- 可调整工作台式
- 可调节气压加载系统或敞开式配置
- 3或4个修整工作环式

特点

- 可生产出高精度的光学平面。
- 降低研磨成本—Kemet(科密特)电子分配系统全面可控，能够准确地向研磨盘定量分配金刚石磨料。
- 装配研磨剂系统：泵，研磨剂桶和可调整流量控制，可用于在研磨或修正研磨盘。
- 高质量的多功能地轴架对研磨抛光机进行支撑。
- 电气系统符合EN 60 204标准。



Kemet

平面研磨机

Kemet (科密特) 36

Kemet(科密特)36焊装有刚性的管状截面钢架，用以支撑变速箱、驱动电机和工作台。拆卸式面板后方安装有一体研磨剂系统：泵，研磨剂桶，可调整流量控制系统及废料桶。机床配备的软启动功能，可在预先设置的时间内，实现研磨盘从零速到全速的平稳加速。

选配项目

- 变速
- 温度控制
- 可调整工作台式
- 可调节气压加载系统或敞开式配置
- 3或4个修整工作环式

特点

- 可生产出高精度的光学平面。
- 降低研磨成本—Kemet(科密特)电子分配系统全面可控，能够准确地向研磨盘定量分配金刚石磨料。
- 装配研磨剂系统：泵，研磨剂桶和可调整流量控制，可用于在研磨或修正研磨盘。
- 适合大型零件和大批量生产。
- 电气系统符合EN 60 204标准。



Kemet (科密特) 研磨抛光机规格

15 | 24 | 36 | 48 | 56 | 72 | 84

KEMET m/c MODEL	15		24	36	48	56	72	84
研磨盘	mm	381	610	914	1218	1422	1828	2132
外径	in	15	24	36	48	56	72	84
研磨盘速度	70rpm		58rpm	58rpm	48rpm	48rpm	30rpm	20rpm
修整环数量	3		3 or 4	3 or 4	3 or 4	3 or 4	4	4
修整环内径	mm	140	248 209	368 322	505 432	578 530	692	813
	in	5.5	9.75 8.25	14.5 12.69	19.9 17	22.7 20.9	27.25	32
开放式机床高度	mm	670	940	940	991	991	914	914
	in	26.5	36	37	39	39	36	36
气压加载系统配置式机床高度	mm		1630	2000	2350	2768	2820	2820
	in		64.2	78.75	92.5	109	111	111
工作高度	mm	310	940	940	1000	1000	912	912
	in	12.2	37	37	39.4	39.4	36	36
机床宽度	mm	760	1220	1600	1422	2057	2120	2401
	in	30	48	63	56	81	83.5	94.5
机床深度	mm	620	1350	1620	2000	2184	2667	2970
	in	24	53.2	63.7	78.7	86	105	117
标准供电	220 -1-50 or 380v or 415v 3Ph-50Hz		220v or 380v or 415v 3Ph-50Hz	220v or 380v or 415v 3Ph-50Hz	220v or 380v or 415v 3Ph-50Hz	220v or 380v or 415v 3Ph-50Hz	220v or 380v or 415v 3Ph-50Hz	220v or 380v or 415v 3Ph-50Hz
主驱动马达马力	0.37kW		1.5kW	4.1kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW
磨料泵马达马力	0.2kW		0.18kW	0.18kW	0.18kW	0.18kW	0.18kW	0.18kW
敞开式配置机床出口包装毛重约	156kg		730kg	1220kg	3800kg	4000kg	6650kg	9979kg
敞开式机床净重约	116kg		555kg	1000kg	2845kg	3700kg	5359kg	8400kg
气压加载系统配置式机床出口包装毛重约	n/a		997kg	1880kg	3570kg	5573kg	9876kg	11923kg
气压加载系统配置式机床净重约	n/a		700kg	1530kg	3145kg	5273kg	7930kg	10439kg

分配系统

Kemet

Kemet (科密特) 电子分配器采用触控设置来实现 Kemet (科密特) 金刚石研磨液和润滑液的分配。数码显示板直观地显示分配时间间隔、时长和空气压力。高达 0.2gm 的分配精度杜绝了浪费，令成本控制更为简单。

Kemet (科密特) 金刚石研磨液搅拌装置配备了一根覆盖有抗污染塑料的小型磁性浆叶，确保了金刚石的均匀悬浮，从而保持浆液中金刚石颗粒的均匀分布。Kemet (科密特) 双联装分配棒的位置可调，可在研磨盘上精确分配金刚石研磨液和润滑液，同时不会发生液体飞溅。

特点

- 可属 Kemet (科密特) 平面研磨抛光机和研磨盘的标配产品。
- 可轻松装到现有的传统平面研磨抛光机，进而提高生产能力。
- 采用独立的压力和时间设置，实现 Kemet (科密特) 金刚石研磨液和润滑液计量的全面控制。
- 安装、操作简便。
- 电气系统符合 EN60 204 标准。



Kemet (科密特) 电子分配器

与研磨抛光机的循环定时器配套使用，能够以预先设置的时间间隔，自动分配 Kemet (科密特) 金刚石研磨液和润滑液。

高度	150mm	所需气压 磅最小 1 Bar (巴) 磅最大 5 Bar (巴)	喷射时长调节范围 1-9 秒	
宽度	230mm			
深度 (不含空气滤清器)	150mm			
净重	3.74kg			
编号	360502	气压	双电路	喷射时间间隔调节范围 1-999 秒
		气压显示	巴或磅 Bar or PSI	喷射记忆 标配
				手超控 标配
				供电 110v 或 220 - 240v 50 或 60Hz (供电电压与频率自适应)



Kemet (科密特) 金刚石研磨液搅拌装置

电动、低噪音、速度全面可调，并配备一根磁性搅拌浆叶。

高度	120mm
宽度	90mm
深度	215mm
供电	50 或 60Hz 230V 110V
编号	360583 360584

Kemet (科密特) 双联装分配杆与盛液瓶

配套提供两个盛液瓶与塑料管。头部全面可调，实现竖直和径向定位。

	标准	加长
长度	340mm	495mm
可达距离	260mm	415mm
高度调节范围	100mm	100mm
头部截面	20mm x 20mm	
盛液瓶容量	400ml	400ml
编号	360511	360510



Kemet (科密特) 单体喷射头

配套提供盛液瓶、瓶盖和塑料管。

	标准	加长	超长
长度	130mm	250mm	380mm
编号	360517	360515	360513



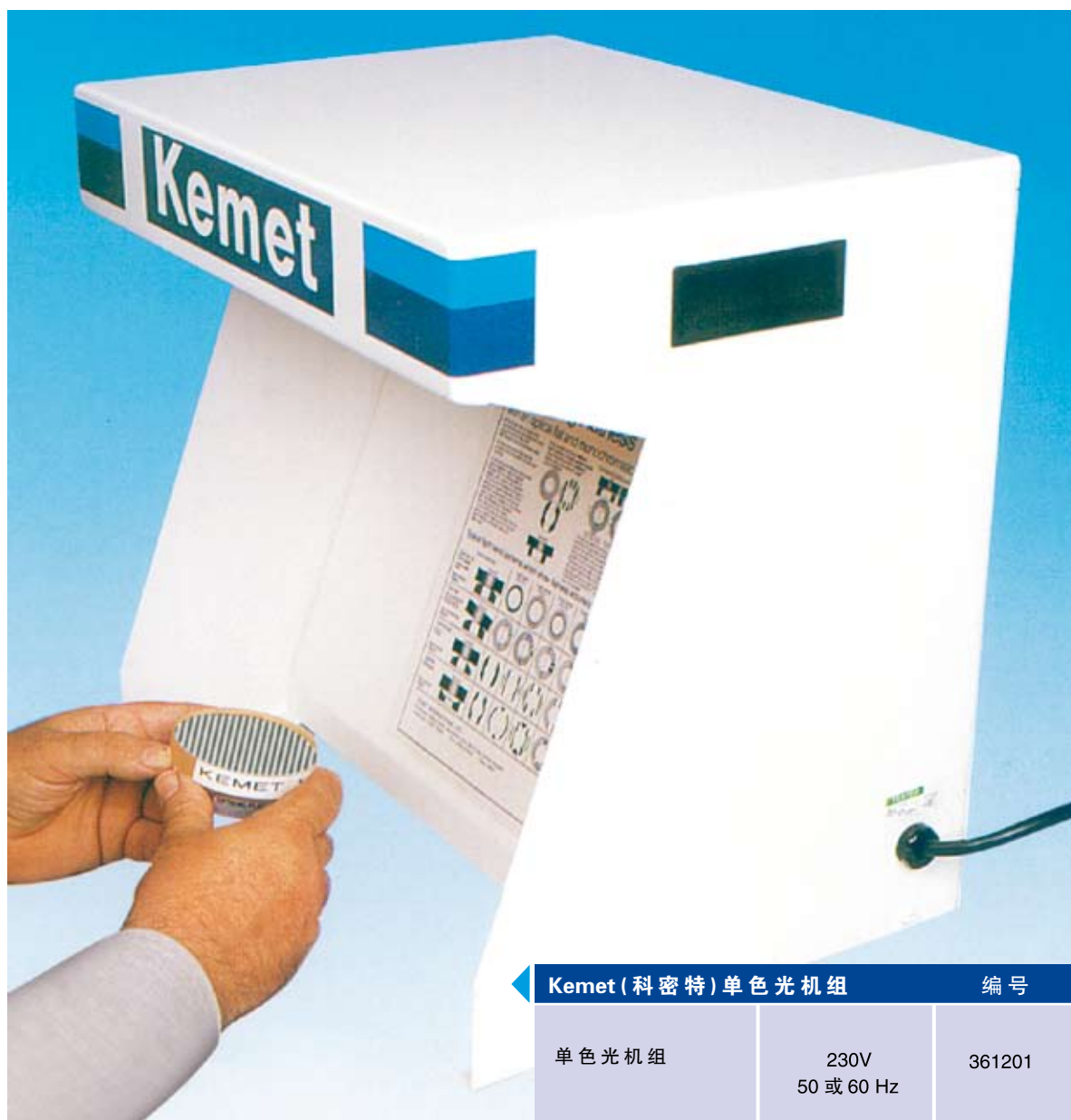
Kemet

平面度测量设备

Kemet(科密特)平面度测量设备与Kemet(科密特)平面研磨抛光系统配套使用，对表面平面度的测量与保持起到辅助作用。

Kemet(科密特)单色光机组

与Kemet(科密特)光学平面使用评估加工元件的平直度。本光机系用标准的商业18w低压钠sox照明灯。附带平面度读解释图表。



Kemet(科密特)单色光机组

编号

单色光机组

230V
50 或 60 Hz

361201

Kemet (科密特) 精密平直度测量仪

本测量仪规用于监视研磨盘平直度，并进而指示出部件的平直度。适用于多数研磨机床尺寸，采用公制或者英制度量衡可供选择。每个测量仪都配有一个硬化钢主控平面和并保存在一个坚固的盒子包装。附带提供详尽的说明书。



Kemet (科密特) 平面度测量规		编号	编号
S型	适用于直径最大 380mm (15 英寸) 的研磨板	361301	361303
L型	适用于直径最大 380mm (15 英寸) 的研磨板	361302	361304



可提取平直度量图表

Kemet (科密特) 光学平面

Kemet (科密特) 光学平面采用玻璃陶瓷或微晶玻璃材质，有单面和双面两种，标准尺寸的直径范围介于25mm到300mm之间。附带提供合格证与使用说明。并有英国国家物理实验室出具的证书。还可应客户要求提供专用的光学平玻璃。Kemet (科密特) 提供光学平面翻修与标定服务。

Kemet (科密特) 光学平面玻璃				
直径 mm	精度 英寸	精度 光带	编号	编号
			单面	双面
25	1	1/4	361143	361101
25	1	1/10	361125	361182
50	2	1/4	361175	361102
50	2	1/10	361157	361119
75	3	1/4	361144	361103
75	3	1/10	361117	361118
100	4	1/4	361104	361105
100	4	1/10	361110	361106
125	5	1/4	361124	361120
125	5	1/10	361191	361173
150	6	1/4	361142	361107
150	6	1/10	361108	361109
200	8	1/4	361158	361164
200	8	1/10	361126	361145
250	10	1/4	361159	361141
250	10	1/10	361127	361128
300	12	1/4	361172	361130
300	12	1/10	361129	361131



手工研磨套件

Kemet

Kemet (科密特) 便携式手工研磨套件

泵、阀门和密封发生泄漏时会导致诸多问题，除引起浪费、功效欠佳，还可造成不必要的成本。通过Kemet(科密特)便携式研磨套件，可在现场进行整修，从而缩短了成本及高昂的停机时间。有了这种套件，就再也不用着花上长时间的人工研磨或抛光那些采用陶瓷、碳化钨、钨铬钴合金、黄铜、钢材、碳化硅、耐蚀高镍铸铁等等材料制成的部件。此套件也适合小量元件生产或研磨和抛光。



L型研磨套件

包括：

- Kemet Iron 研磨盘(用于研磨)，直径348mm，带同心凹槽。
- 1 x 10g Kemet 金刚石复合膏棒 - 25微米 (micron)。
- 1 x Kemet OS 润滑液。
- 1 x 抛光木箱，含操作说明书。

P型抛光套件

包括：

- Kemet XP 抛光盘(用于抛光)，直径348mm，带同心凹槽。
- 1 x 10g Kemet 金刚石复合膏棒 - 3微米 (micron)。
- 1 x Kemet OS 润滑液。
- 1 x 抛光木箱，含操作说明书。

3 Lap 研磨抛光套件

包括：

- Kemet Iron 研磨盘(用于研磨)，直径150mm，带防滑背板。
- Kemet XP 抛光盘(用于修匀)，直径150mm，带防滑背板。
- Kemet Tin 研磨盘(用于抛光)，直径150mm，带防滑背板。
- 1 x 10g Kemet 金刚石复合膏棒 - 25微米 (micron)。
- 1 x 10g Kemet 金刚石复合膏棒 - 8微米 (micron)。
- 1 x 10g Kemet 金刚石复合膏棒 - 3微米 (micron)。
- 1 x Kemet OS 润滑液。
- 1 x 抛光木箱，含操作说明书。

Kemet (科密特) 平面度测量规

编号

L型研磨套件

352216

P型抛光套件

352208

3 Lap 研磨抛光套件

352206

Kemet (科密特) 抛光垫

Kemet (科密特) 抛光毡垫

许多硬度较低的材质必须使用抛光垫方可实现抛光面的平整。Kemet(科密特)提供多种抛光毡垫产品可与大多数平面研磨机配套。Kemet(科密特)提供种类最多的自粘式抛光毡垫。这些抛光毡垫主要有三种类型：

合成丝织垫

多种合成丝织垫，采用经久耐用的羊毛结构，可在不锈钢、钨铬钴合金和其它多种金属上进行镜面抛光。

ASFL-AW - 在多种金属上取得最佳的镜面抛光效果。抛光垫粘性可耐油耐水，适合所用的抛光磨料。

ASF-AW - 丝织垫，带防水自粘衬布。本品虽然也可进行镜面抛光，但更适合在珠宝等产品上进行平直度不太重要的装饰性抛光。

化纤织物抛光垫

不织布抛光垫，专门针对抛光工艺制造。

PSU - 分为柔软、中硬和坚硬。与金刚石和非金刚石磨料配套使用。一种较好的通用抛光垫，寿命相对较长。

CHEM - 与 **COL-K** 抛光剂配套使用，用于化学研磨机械抛光工艺。在钛、钴、铬等许多特殊材料中都需要采用化学机械抛光工艺。

起绒织物抛光垫

尤其适合于低硬度的材质和金属。

NMH - 在斜纹棉衬布上粘结单向纤维，经久耐用、耐磨。

NLH - 更长、更坚韧的一种起绒织物抛光垫，用于某些光学抛光作业。



Kemet (科密特) 抛光垫

类型	编号	
	直径380mm	直径610mm
PSU - S	341016	341043
PSU - M	341011	341012
PSU - H	341004	341006
ASFL - AW	341112	341113
ASF - AW	341109	341145
CHEM	341927	341930
NMH	341221	341252
NLH	341248	341253

有多种规格和特制抛光垫可依照需求而定制。

Kemet

耗材、备件和配件



KEMET (科密特) 提供范围最广的磨料产品，包括研磨液、研磨膏、悬浮研磨剂和粉剂。并有各种氧化铝、碳化硅和碳化硼磨料的粒径。

Kemox

一系列精制的悬浮态磨料，由适当比例的磨料和载体预先混合而成，提高了研磨过程的洁净度与生产效率。

研磨膏

KEMET (科密特) 生产多种研磨膏，其中的SABRE采用氧化铝制成，适用于多数精细研磨作业。我们生产的碳化硅和碳化硼系列研磨膏用途广泛，尤其适合机械密封和阀座的研磨。

Col-K

一种液体抛光剂，在抛光机上与KEMET CHEM化纤布抛光垫配套使用，可实现优质的镜面抛光。它可产生一种“半研磨、半化学”的抛光作用，非常适于对钨铬钴合金和钴铬合金等难于抛光的材料进行抛光。

KDS811

金 刚 石 悬 浮 磨 料 ， 适 用 于 双 面 研 磨 机

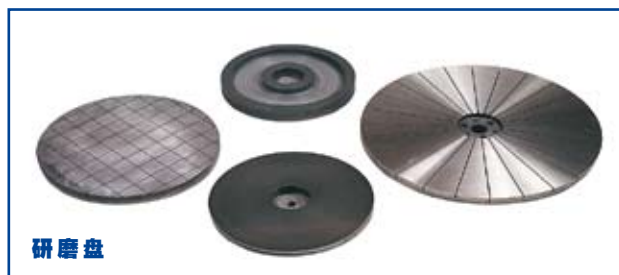
KEMET (科密特) 开发的这种优质一流的金 刚 石 悬 浮 磨 料 式 用 于 双 轮 研 磨 制 程。KDS811具备自润滑能力，并提高研磨制程切削率。该产品与蠕动泵配套使用时可代替非金 刚 石 磨 料。

Kemet (科密特) 拥有大量耗材、备件和配件，可共用于Kemet (科密特) 研磨系统。

在选择研磨盘或者磨料时，我们还将免费为您提供制程工艺建议。

研磨盘

我们对所有磨损的Kemet (科密特) 研磨盘均提供零件替换服务。此外还为多数研磨机床提供铸铁和软金属材质研磨盘。



调整环

在研磨过程中调整环会发生自然磨损。多数平面研磨机型号都可更换。



金刚石分配系统零件

当前所有Kemet (科密特) 分配系统，都可随时提供零件进行更换和零件替换。



工件固定垫

所有机床均可提供防滑毡垫，同时还可提供圆形的工件夹具坯料。



Kemet

工具清洗设备

Kemet (科密特) 超声波清洗设备

一般的工业制造商都需要一些高清洁度的零部件。(典型的应用包括研磨及抛光后的部件。例如：机械密封等搭接配合部件，阀门，光学部件和医疗设备的清洗)。

使用Kemet(科密特)超声波清洗设备是无需移动物件，振动式超声波振动器可在水性清洗液中产生显微气泡来清洗不规则，位置难于触及的物件，或物件上面的灰尘，水垢和杂物均可被彻底振落。

特点

- 超声波功率强劲，可实现良好的清洗。
- 恒温间接加热（加热板安置于侧壁内）。
- 底板向排污阀倾斜。
- 内置超声波发震器。
- 采用电子控制，具备温度，时间的调数和显示。
- 水槽内液位不足时，液位保护装置可停止加热和超声波发射。
- 双层盖，绝热隔音。
- 可通过溢流挡来撇取油沫。



Kemet 超声波清洗型号一展表

型号	Mi-40	Mi-80 (600W)	Mi-80 (1200W)	Mi-160 (1200W)	Mi-160 (2400W)
槽体容积 (升)	40	80	80	160	160
外形尺寸 (mm)	640L x 390W x 540H	760L x 460W x 720H	760L x 460W x 720H	1340L x 460W x 770H	1340L x 460W x 770H
槽体尺寸 (mm)	475L x 265W x 300H	585L x 330W x 400H	585L x 330W x 400H	1180L x 330W x 400H	1180L x 330W x 400H
清洗篮尺寸 (mm)	425L x 230W x 225H	540L x 290W x 340H	540L x 290W x 340H	1110L x 280W x 300H	1110L x 280W x 300H
清洗重量 (kg)	5	20	20	40	40
超音波频率 (KHz)	30	30	30	30	30
超音波功率 (W)	600	600	1200	1200	1200
加热功率 (W)	1500	2000	2000	6000	6000
电压/频率 (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
耗电功率 (W)	2100	2600	3200	7200	8400

尺寸与数据如有变更，恕不另行通知

KemeSonic Plus 超声波清洗液

生物降解型水基浓缩液，请询问目录供参考。

可应客户要求提供特殊类型和尺寸的清洗设备。

K e m e t (科 密 特) 研 磨 抛 光 分 包 服 务

若您有零部件如果不能达到要求和难于研磨时，或者交货时间紧迫时，解决办法就是Kemet(科密特)的分包服务。我们以优越及可靠的服务并且快速交易。

我们拥有广泛的多样化专业技术：包括机械密封、阀门、光盘模具镜面、平面塑料铸模镶块、比较仪镜台、垫片、刀具圆盘和航空器机泵部件。



机床说明

我们的机床配备有标准和特殊研磨板，可加工多数部件类型。最大可对直径530mm（约21英寸）的部件进行研磨和（或）抛光。

能力

我们可将多数材料加工到特定的表面光洁度和平面度。并可研磨带凸肩部件，如中间有隆起的部件和轴件。

质量

所有工件在返回客户时都要附带合格证，上面注明与客户图表或者规格一致的加工表面光洁度和平面度。

服务

我们的信誉来自于优越及可靠的服务，并且专长于快速交易。



Kemet

Kemet (科密特) 技术中心

Kemet(科密特)技术中心配套齐全，可提供工艺开发、培训和技术支持服务。

工艺开发

Kemet(科密特)不断借助于精密平面研磨技术的最新成果进行新产品、新工艺开发，持续为客户提供更多的帮助。我们可对客户的样品进行免费评估，并出具综合性的评估报告，其中涵盖工艺制程方面，详细说明磨料、研磨盘、工件固定垫、检验、清洗及可能涉及的耗材成本。

培训

定期在Kemet(科密特)技术中心或者客户现场提供量身定做的培训课程。

典型科目有：

- 研磨抛光理论
- 机器设置与操作
- 平直度控制与测量
- 磨料类型
- 研磨盘类型
- 工件固定方法
- 产品清洗与检验

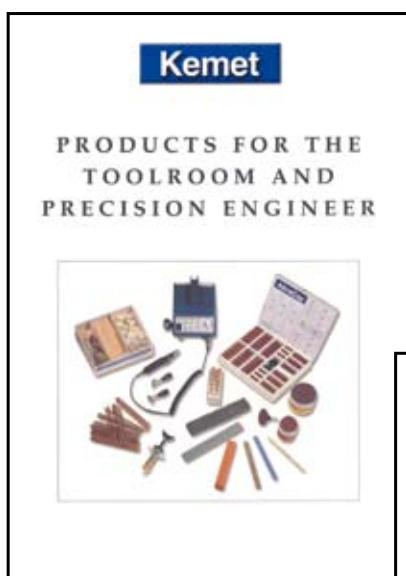
课程结业后向参训人员颁发证书（包括开课日期和所涉科目）。

Kemet(科密特)售后服务与支持

公司技术代表团队与技术中心团队紧密协作，不断为预期客户和现有客户提供技术支持服务，确保所有问题都能得到迅速解决。



Kemet (科密特) 另有其它产品目录可供索取



模具及精密工程用产品

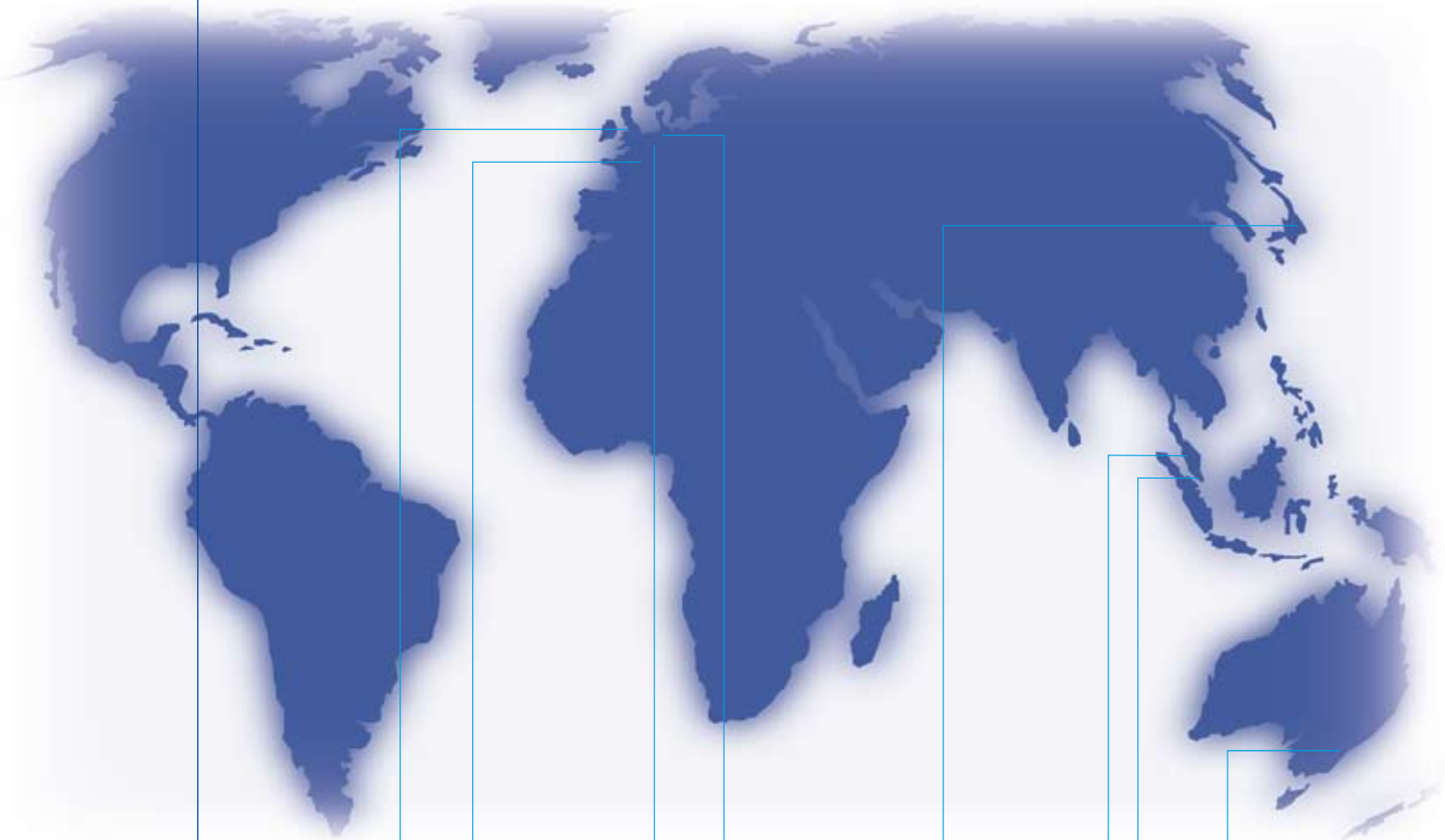


砂纸与配件



金相学耗材

KEMET (科密特) 拥有精密工艺制程, 均可提供培训课程



英国
Kemet International Ltd

法国
Kemet Europe S.A.R.L.

比利时及卢森堡
Kemet Europe B.V.B.A.

荷兰
Kemet Europe B.V.

日本
Kemet Japan
Company Ltd

新加坡
Kemet Far East Pte Ltd

马来西亚
Kemet Precision (M) Sdn Bhd

澳大利亚
Kemet Australia Pty Ltd

Kemet International Limited

Cuxton Road Parkwood Trading Estate

Maidstone Kent ME15 9NJ United Kingdom

Tel: +44 (0) 1622 755287 Fax: +44 (0) 1622 670915

E-mail: sales@kemet.co.uk Website: www.kemet.co.uk